中華民國專利公報(19)(12)

(11)公告編號:323636

Ņ

〔41〕中華民國86年(1997)12月21日

21/02

新型

全 8 頁

(51) Int · C | 6:865085/90 1/36

(54)名 帮:1C用承載盤

(21)申 額 案 號:86200518

(22)申請日期:中華民國86年(1997)01月13日

(72)創作人: 陳志明

新竹市光復路一段一〇八巷八十弄九號

(71)申 請 人: 永旭先進科技股份有限公司

新竹市南大里西大路一二六號

(74)代 瑶 人:洪澄文 先生

1

[57] 申請專利範圍:

1. 一種 IC 用承載盤,具有一第一表面與 一第二表面,藉由該第一表面與該第二 表面上之容座來定位 IC,該 IC 用承載 盤包括:

複數第一IC 容座,為一具有穿孔的承座,該等第一IC 容座係形成於該IC用承載盤之該第一表面上,於每一該等第一IC 容座的周圍具有斷續之複數第一定位凸塊組,藉由該等第一定位凸塊組來導入IC 進入該等第一IC 容座之IC 支承面上,使得該IC 在最少的該第一定位凸塊組數目下完成定位:

複數第二IC容座,形成於該IC用承載盤之該第一表面之背面的第二表面上,每一該等第二IC容座係分別以相對排列設置於每一該等第一IC容座之位置的背面,於每一該等第二IC容座的周圍設置有斷續之複數第二定位凸塊,藉由該等第二定位凸塊以達到放置該IC而不產生移動之最少凸塊:

2

一凸肋,形成於該 IC 用承載盤之該第一表面之周圍,藉由該凸肋來支撐及定位該 IC 用承載盤上方之另一 IC 用承載盤:

5. 其特徵在於:

各該等第一IC 容座之四個角落的該等第一定位凸塊組係由複數L型凸塊與複數 T型凸塊組係由複數L型凸塊與複數 T型凸塊所組合成,藉由該等T型凸塊的交互排列可達到定位該IC 用承載盤之該第一產生移動,在該IC 用承載盤之該第一表面上之最外側的四個角落上係設置,於置相對應的該等L型凸塊來設置,而於其是可以交錯方式來設置,各該第一IC 容座僅利用一對角上之兩個該T型凸塊之相對直角位置來定位該IC 用承載盤之該第一表面上的該IC 用承載盤之該第一表的

等第一定位凸塊組係以交錯排列的方式

20.

10.

15.

10.

設置於各該第一IC 容座之四個角落上,其中,藉由該第一容座之其中一對角上的該第一定位凸塊組便可以來定位該IC,節省另一對角上凸塊的重置,並且在不影響該IC 用承載盤之結構強度下,以適當的該穿孔面積來設計,因而降低該IC 用承載盤在藉由適當的夾持裝之該IC 用承載盤在藉由適當的夾持裝置夾持後,可在任何的角度下經由該穿孔來檢視該IC 之焊接狀況。

- 2. 如申請專利範圍第1項所述之IC用承載盤,其中,該等第二定位凸塊上均形成有一階級座,藉由該等階級座上之各階級座平面來定位該IC。
- 3. 如申請專利範圍第1項所述之IC用承載盤,其中,該等第一IC容座及該第二IC容座係以矩陣n×m的排列方式來設置,並且該穿孔以最大矩形面積來形成。
- 4. 如申請專利範圍第 3 項所述之 IC 用承 載盤,其中,藉由該等穿孔更可以檢視 該 IC 之焊接狀況。
- 5. 如申請專利範圍第1項所述之IC用承載盤,其中,該IC用承載盤之兩側邊上更形成有握持把手。
- 6. 如申請專利範圍第5項所述之IC用承 載盤,其中,該握持把手上更形成有至 少一定位槽孔。
- 7. 如申請專利範圍第1項所述之IC 用承 載盤,其中,於該第一表面上之部分該

4

等第一 IC 容座位置上以具有平面之非 穿孔形式來設置,藉由該等非穿孔之平 面做為吸附面。

8. 如申請專利範圍第7項所述之IC用承 載盤,其中,於該第一表面上之該等第 一IC 容座均以具有穿孔型態之承載面 來設置。

圖示簡單說明:

> 第五圖係表示本創作 IC 用承載盤 之第一實施例的頂部結構立體圖:

第六圖係表示於第五圖中之底部結 20. 構立體圖:

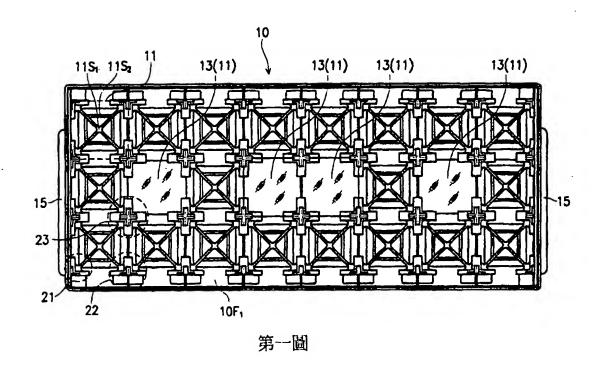
第七圖係表示本創作兩片 IC 用承 載盤於裝載 IC 前之立體示意圖:

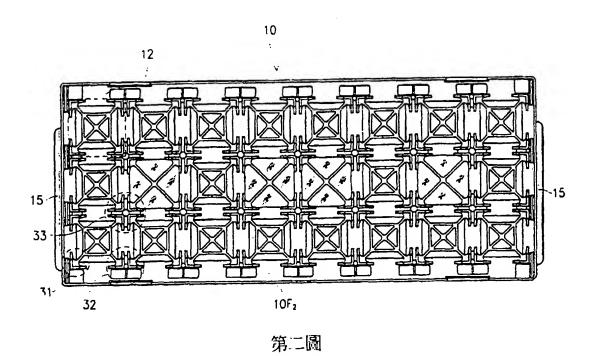
第八圖係表示 IC 在第七圖中完成 裝載後之立體組合圖:

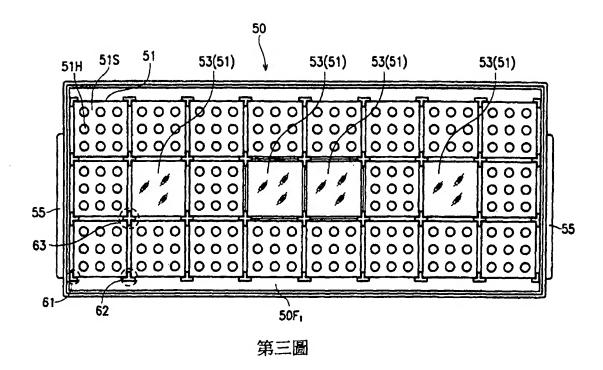
25. 第九圖係表示於第八圖之底部結構 立體圖:

第十圖係表示本創作 IC 用承載盤 之第二實施例的頂部結構立體圖;及

第十一圖係表示於第十圖中之底部 30. 結構立體圖。







50 52 ত তাতি ০ তা 000 000 000 000 000 000 000 1000 0 0 0 0 1000 000 000 000 рооол лоооп 000 ত্তি ০ তাত 50F₂

第四圖

